

## 中性粒子ビーム酸化により制御された Nb酸化膜厚が超伝導共振器性能に与える影響

### Effects of Nb oxide film thickness controlled by neutral beam oxidation on superconducting resonators

東北大流体研<sup>1</sup>, 東北大 AIMR<sup>2</sup>, 産総研<sup>3</sup>, 東理大<sup>4</sup>, 理研 RQC<sup>5</sup>

<sup>○(M2)</sup>紺野 太壱<sup>1</sup>, 大堀 大介<sup>1</sup>, 日高 瞳夫<sup>3</sup>, 野田 周一<sup>3</sup>, 遠藤 和彦<sup>3</sup>, 向井 寛人<sup>4,5</sup>,

朝永 顯成<sup>4,5</sup>, 蔡 兆申<sup>4,5</sup>, 寒川 誠二<sup>1,2</sup>

IFS, Tohoku Univ.<sup>1</sup>, AIMR, Tohoku Univ.<sup>2</sup>, AIST<sup>3</sup>, TUS<sup>4</sup>, RQC, RIKEN<sup>5</sup>

<sup>○(M2)</sup>T. Konno<sup>1</sup>, D. Ohori<sup>1</sup>, M. Hidaka<sup>3</sup>, S. Noda<sup>3</sup>, K. Endo<sup>3</sup>, H. Mukai<sup>4,5</sup>,

A. Tomonaga<sup>4,5</sup>, J.S. Tsai<sup>4,5</sup>, S. Samukawa<sup>1,2</sup>

E-mail: taichi.konno.r5@dc.tohoku.ac.jp, samukawa@ifs.tohoku.ac.jp

#### 【緒言】

多くの選択肢から最適解を求める経路最適化や化学物質の組み合わせなどの分野において、非ノイマン型コンピュータである量子コンピュータを用いて高速に効率よく解を得ることが期待されている[1,2]。超伝導量子コンピュータにおいて単一光子を介して情報の伝達、読み出しを行うNb超伝導共振器の性能向上が要求されている。単一光子を高感度に取り扱うためには、超伝導共振器の内部損失に起因するQ値の向上が必須である。Nb酸化層には絶縁体のNb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>と金属的な性質を有するNbOやNbO<sub>2</sub>などのサブオキサイドがあり[3]、これらの酸化膜の膜厚や組成比は加工やその後の表面処理条件に依存している。サブオキサイドはNb超伝導共振器の損失を増加させ、Q値の低下につながっていることが示唆されている[4]。本研究では、SF<sub>6</sub>中性粒子ビーム(NB)を用いた低欠陥加工を行った試料に対して表面酸化膜厚をNBO酸化(NBO)によって制御し、高いQ値が得られるNb表面酸化条件を検討した。

#### 【実験方法と結果】

Siウェハ上にスパッタ法を用いてNb膜を50 nm堆積させた試料を用意し、共振器パターンを形成した。この試料に対してステージ温度30 °C、SF<sub>6</sub>NBEで加工を行った。加工後に、Si基板上のSiO<sub>2</sub>をNF<sub>3</sub>ガスを用いたドライ処理により除去し、その後にNBOをFig. 1に示す条件で行い、Nb酸化膜(Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)厚を変化させた。透過型電子顕微鏡によりNb酸化膜厚測定および同様の処理を施したNb共振器のQ値を10mKにおいて測定した。Fig. 1に各NBO後のNb表面酸化膜の透過電子顕微鏡像を示す。NBOパワー及び時間によって、Nb酸化膜の形成がÅオーダーで制御できており、かつNb酸化膜とNb界面は非常に滑らかである事が分かった。Fig. 2にFig. 1から見積もられたNb酸化膜厚とQ値の関係を示す。Nb酸化膜(Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)厚を薄く制御することで、高いQ値が得られることが分かった。NBOにより形成した酸化膜は長期間に渡り高い安定性を有することが過去の報告より分かっている[5]。したがって、NBO処理を行った安定な極薄Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>が表面を覆っているNb共振器は、高いQ値を長期にわたり安定して保持することができる。

#### 【参考文献】

- [1] S. Tanaka, 知能と情報 **30**, 42 (2018).
- [2] C. Neill, et al., Science **360**, 195 (2018).
- [3] G. V. Chandrashekhar, et al., J. Solid State Chem. **2**, 528 (1970).
- [4] 紺野太壱ほか, 第68回応用物理学会春季学術講演会, 18p-Z27-7.
- [5] T. Ohno and Seiji Samukawa, Appl. Phys. Lett. **106**, 173110 (2015).

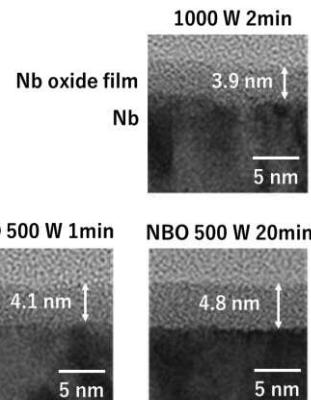


Fig. 1 Nb surface TEM images with various NBO conditions.

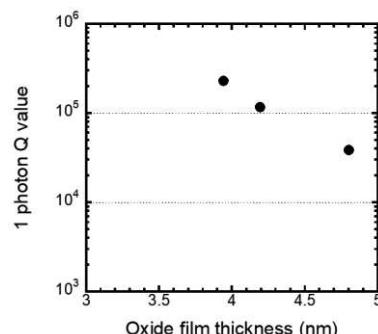


Fig. 2 Relationship between Nb oxide film thickness and Q value.